混合量子気体のダイナミクス観測にむけた

リング型光ポテンシャルの開発

先進理工学専攻 岸本研究室 稲田 寛之

1 背景と目的

ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)状 態の原子の重要な性質の一つとして超流動 性が挙げられる。1995年にBECの生成 が確認されて以来、このような量子気体は 超流動現象の研究対象として重要な地位を 築いてきた。

量子気体における超流動性は量子渦によ り顕著になる。一般的に量子渦は、波動関 数の位相整合性により量子化された循環を もつが、リング型の擬一次元的なポテンシ ャル中に閉じ込められた2成分の量子気体 においてはその限りではない。そのような 系では斥力相互作用により2成分が分離さ れ、1つの成分がもう片方の成分により切 断された状態になると波動関数の位相整合 性が適用されなくなるからである。このと きそれぞれの循環は量子化されない。一方、 相互作用が弱く2成分が完全に混ざりあっ た状態では、位相整合性からそれぞれの成 分の循環は量子化される。

本研究室ではフェッシュバッハ共鳴によ り相互作用を制御することで、例えばリン グポテンシャル中の2成分系を非量子化さ れた循環から量子化された循環へ移行させ る実験を目指している。このとき変化の前 後で全角運動量が保存されることから、非 自明なダイナミクスが起こることが予想さ れる。今回はそのような実験の実現にむけ、 原子を捕獲するのに必要なリング型光ポテ ンシャルの開発を行った。



図 1 混合分離性の変化

2 リング型光ポテンシャル

本研究ではガウシアンビームの掃引によ りリング型光ポテンシャルを目指す。リン グ型の光は Laguerre-Gaussian beam によ り生成することも可能だが、ポテンシャル に捕獲された量子気体に任意の角運動量を 与えるためにリングの変形や回転操作を行 いたいなどの理由から今回のような手法を 採用した。

2.1 理論

ガウシアンビームの掃引によるリング光 の光強度は以下のように計算される。 l(r)

$$= \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left\{ \frac{2P}{\pi w_{0}^{2}} \exp\left(\frac{-2(r - a\cos(\omega t))^{2} + (0 - a\sin(\omega t))^{2}}{w_{0}^{2}}\right) \right\} dt$$
$$= \frac{2P}{\pi w_{0}^{2}} \exp\left(\frac{-2(r^{2} + a^{2})}{w_{0}^{2}}\right) \Gamma_{0}\left(\frac{4ar}{w_{0}^{2}}\right) \qquad (1)$$

P、a、woはそれぞれビームのパワーとリン グの半径、焦点におけるビーム半径である。 また Γ_0 は0次の変形ベッセル関数である。

式(1)により計算した Stark shift とトラ ップ周波数を図2,3に示す。本研究では リング型光ポテンシャルにより擬1次元系 を用意したいため w_0 とaの比をできるだけ 大きくとれるようにしたい。したがって今 回は我々の系において現実的な値として w_0 を 3μ m として計算した。また P=1mW とした。例えば $r=20 \mu$ mの値に注目すると、 それぞれの値は319nK と585Hzである。 K.Henderson のグループも近い条件で (P=1.5mW, $w_0=2.5 \mu$ m, $a=20 \mu$ m)で実験を 行いリング型光ポテンシャル中で BEC を生 成しているため、これらの値は妥当である といえる[1]。したがって今回は $w_0=3\mu$ m, $a=20 \mu$ m としてリングの設計を行った。





2.2 ビーム間隔の計算

今回のシステムではガウシアンビームの 位置を離散的に変化させることでビームの 掃引を実行する。本研究ではポテンシャル の底が滑らかな系への原子の捕獲をめざし ているが、今回の方法ではポテンシャルの 底にリップル構造を形成してしまう。リッ プルの大きさをビームの間隔に対して計算 したプロットが図4になる。この計算では 簡単のためリングではなく1次元的にビー ムを並べたモデルについて計算した。また、 ポテンシャルの深さは常に319nKとしてい る。このグラフから、ビームの間隔が広が ることでリップルの大きさが大きく増加す ることが分かる。したがって、ポテンシャ ルの底を滑らかにするためにはビームの間 隔を狭くする必要がある。





今回はリップルの大きさがリングポテン シャル中の BEC の化学ポテンシャルのよ り十分小さい場合、原子にとってポテンシ ャルが十分滑らかであると考えることにし、 両者の比が 1:1000 以上になるようなビー ム間隔を選択することにした。

リングポテンシャル中の BEC の化学ポ テンシャルは次式から求まる[2]。

$$\mu = \hbar \sqrt{\omega_r \omega_z} \sqrt{\frac{3 N a_s}{4 a}} \qquad (2)$$

N、asは原子数とs波散乱長、 ω r、 ω zはそれぞれ動径方向とリングに垂直な方向のトラップ周波数であるが、今回の計算では ω r= ω z とする。式(2)に先ほどのリングポテ

ンシャルのパラメータ(a=20 μ m, ω r=2 π × 585Hz)と⁸⁷Rbのas=100ao(ao:ボーア半径)、 我々が目指す原子のオーダーN=10⁵を代入 すると μ =140nKとなった。したがって今回 はビームの間隔を 2 μ m として回折光掃引 のシステムを開発することにした。このと き半径 20 μ m のリングは65点の回折光に より構成される。

3 FPGA と DDS による周波数変調波 生成システム

本研究では2軸のAcousto-Optic Deflector(AOD)の回折光を掃引することに よりリングを描けるシステムを構築した。 AOD は結晶の屈折率変化を利用した一種 の位相型回折格子であり、入力信号の周波 数と振幅によりそれぞれ回折角と回折効率 が決まる。回折角は周波数に対し線形的に 変化するため、2軸のAOD に入力する交 流電圧の周波数をそれぞれ正弦的、余弦的 に変化させることでリングの形に回折光を 掃引することができる。

回折光の位置は時間的に変化するが、掃 引をトラップ周波数より十分速く実行する ことで時間平均ポテンシャルとしてリング 型ポテンシャルを実現し、原子を捕獲する ことができる。今回は高速に周波数を掃引 するために Field Programmable Gate Synthesizer(DDS)を採用した。

3.1 DDS の周波数制御システム

今回は FPGA に DDS の周波数書き換え プログラムを作製した。DDS は完全にデジ タル信号で制御されるため、高い周波数安 定性と周波数分解能をもち、回折光の掃引 を再現性良く繰り返すことができる。一方、 FPGA はプログラムの並列処理が可能であ り、また内部クロックの速度の I/O 動作で ダイレクトに DDS の制御を実行できるた め高速に周波数を書き換えることができる。

今回は DDS として ANALOG DEVICE 社の AD9858、FPGA として Xilinx 社の XEM3001 を使用した。50MHz の内部クロ ックで駆動される XEM3001 によりパラレ ル通信で AD9858 を制御することで、400ns に1回の周波数書き換えを可能にした。前 節からリングー周は65点の回折光で構成 されるので掃引周波数は約38kHz となる。 これはトラップ周波数585Hzに比べて十分 高速であり、先行研究[1]からも時間平均ポ テンシャルが実現可能であることが十分考 えられる。

3.1.1 システムの概要

今回は FPGA のインターフェースとして LabVIEW を使用した。LabVIEW では FPGA のプログラミングの制御と必要なパ ラメータの指定を行う。



図 5 DDS 制御のタイミングサイクル

また、FPGA へ転送する周波数データを text file で指定できる機能をもたせた。こ のことにより、必要な周波数データを mathematica などの数値計算ソフトによ り用意することで DDS の出力周波数の複 雑な変調もできるようにした。

FPGAにプログラミングした DDS 制御 サイクルを図 5 に示す。今回は FTW の書 き込みだけでなく、出力周波数の読み出し も行うことでデバックを行いやすくした。 FTW の書き込みと読み出しを交互に実行 するため、1 サイクルが 20CLK(=400ns) となった。

3.1.2 回折光の確認

今回のシステムでは1台の XEM3001 で2台の AD9858 を制御し、2軸の AOD でリング型に回折光の掃引を行った。 CCD に結像した回折光が図6である。今 回はシステムの操作確認が目的だったの でリングの大きさにこだわらずに結像し ている。



図 6 回折光の掃引によるリング

この結果からリングは確認できるがそ の形は真円から少し歪んでいる。これは今 回のシステムでは周波数を描きかえる時 間がAODの応答に比べて早すぎることが 原因だと考えられる。本研究ではリングの 大きさとビーム径の比を大きく取りたい ので、結晶の大きなAOD(IntraAction 社 製、DTD-274HA6)を使用している。今回 のシステムでは 400ns の周期で周波数を 書き換えているが、これが AOD の結晶中 を音波が伝搬する時間に比べて早いため、 ビームが当たる結晶の位置によって受け る回折の効果が変わるのだと考えられる。 DTD-274HA6 のスペックシート[3]によ ると直径 1mm のビームに対し Access Time が 1.6µs であることから、今回の実 験のように直径約 1mm のビームを使用 する場合には、周波数の書き換え時に 1.6µs 以上の時間間隔をあける必要があ ったと考えられる。

したがって本研究の実験系においては、 時間平均ポテンシャルに向け回折光の掃 引速度を上げるために、単に周波数の書き 換えを速く実行すればよいというわけで はないことが分かった。今後は書き換え時 間を調整できるような機能をプログラム に追加することで、最適な書き換え速度の 領域で実験を行う必要がある。

3.2 循環状態への移行にむけた 光ポテンシャル操作

本研究では非対称なポテンシャルを回 転させることで、捕獲された原子に任意の 角運動量を与える手段を取る[4]。今回は 非対称な形として、リングの一部に欠陥が ある場合(C型)と、楕円について考えた。

3.2.1 回転システムの概要

今回のシステムでは、異なる回転角のポ テンシャルを順次切り替えていくことで 回転を実行する。回転を高速に実行するた め、プログラム実行中に LabVIEW から 周波数データの転送を行いたくなかった ので、回転に必要な全ての周波数データは あらかじめ FPGA の RAM に格納するよ うにした。したがって掃引できるポテンシ ャルの数が限られるため、回転の滑らかさ は RAM の容量に依存する。今回使用した FPGA ボード XEM3001 は RAM の容量 が約 12800bit であり、これは65点で構 成されるリングでは61種類のポテンシ ャルしか掃引で用意することが出来ない。 これは円が一周 360 度であることを考え ると明らかに不十分である。したがって今 後はより大容量の RAM を採用すること で回転を滑らかに行う予定である。今回は 主に回転システムの構築と動作確認を目 的とし開発を行った。

3.2.2 C 型ポテンシャル

この操作では前節で設計した真円のリ ングの一部に欠陥を生じさせた形のポテ ンシャルを使用し、欠陥の位置をリングに よって変化させていくことで実効的にポ テンシャルを回転させ、最終的に欠陥をう めることで循環状態への移行を目指す。

今回のシステムではポテンシャルの回 転速度ω(t)は原子が欠陥の位置に追随す るように、遅い状態から目的の速度まで加 速するようにプログラムを設計した(図 7)。





このプログラムではリングを切り替える 時間を初期設定の το から短くしていくこ とで回転速度を上げている。その変化量は ポテンシャルの番号 n に比例させている ため図7に示すような増加になる。開始時 の切り替え時間 τ_0 、切り替え時間の一回 の変化量 $\Delta \tau$ 、 $\omega(t)$ を変化させる回数 n'は LabVIEW から操作可能にした。

今回のプログラムではポテンシャルの 形を65回切り替えることで回転を実行 している。このことから、実現可能な回転 周波数は 1/(26µs×65)=592Hz となる。 これに対し、例えば渦度1の量子渦がもつ 大きさ程度の角運動量を与えたい場合、超 流動速度を求める式⊽ = ħ/2M∇φ(M:原子 の質量、 (な): 波動関数の位相) から求まる速 度v~0.0365mm/s程度でポテンシャルを 回転させればよい。この値は2π×592Hz ×20µm~74.4mm/s より小さいので、今 回のシステムで十分実験が可能である。ま た、今後 RAM の増加によりリングの数を 10 倍まで増やし、より滑らかに回転させ たとしても角運動量を与えるには十分高 速な速度領域である。



図 8C型リング

今回のシステムにより得られた C 型の 回折光を CCD に結像したものを図 8 に示 す。欠陥の部分に注目すると本来回折光が 当たらない部分も僅かに光があたってい るように見える。この原因もまた周波数を 書き換える速度が AOD の応答より早すぎ るためだと考えられる。

3.2.2 楕円型ポテンシャル

楕円形に歪ませたポテンシャルを回転 させることで BEC に量子渦を生成する実 験は過去に実証されている[4]。この実験 は調和型ポテンシャルに捕獲された原子 集団を対象にして行われているが、我々は リングを楕円に歪めたポテンシャルに捉 えられた原子に対して同様の実験を試み る。

今回のシステムでは真円のリングが回 転速度ωで回転しながら半周の間に楕円 に変形し、n周回転した後、回転しながら 再び半周の間に真円に戻るようにプログ ラムを設計した。それぞれのパラメータ、 ωとnはLabVIEWから操作可能にした。

また回転を構成するそれぞれの楕円は mathematica により計算した。その際に、 楕円の周囲長が楕円の変形時に常に一定 になるように注意した。これは周囲長が変 わることによってポテンシャルの深さが 変動し、parametric heating が起こるの を防ぐためである。また、ビームの間隔も 常に一定になるようにした。

CCDに結像した回折光を図9に示す。



図 9 楕円型リング 4 まとめと今後の展望

今回はFPGAとDDSを用いて周波数変 調波生成システムの開発を行った。回折光 の掃引により時間平均ポテンシャルを実 現するためには回折光の掃引をトラップ 周波数より十分高速に行う必要があるが、 今回のシステムでは掃引周波数として 38kHzを達成し、時間平均ポテンシャル が十分可能と考えられる速さで掃引が行 えた。しかし、今回はシステムで実現でき る最短時間(400ns)で DDS の周波数を書 き込んでいたため、AOD の結晶中を音波 が伝搬する時間に比べて早く周波数が切 り替わり、その結果、ビームが結晶にあた る位置によって受ける回折効果が変わり、 真円で得るはずの回折光が楕円型になっ た。したがって、今後は周波数を切り替え る機能をプログラムに追加し、最適な切り 替え時間の領域を探す必要がある。

次に任意の角運動量を与えるための光 ポテンシャルの操作のためのシステムの 開発を行い、動作を確認した。今回はRAM の容量の少ない FPGA を用いたため、回 転の滑らかさなどで大きく制限されたが、 今後はより容量の大きな FPGA を用いるこ とで、より自由度の高いポテンシャル操作 を目指す。

最後に、今回の開発にあたって FPGA の技術習得のために半年間ご指導下さっ た志賀信康博士、木戸耕太研究員に深く感 謝を申し上げます。

参考文献

[1]Henderson.K,C.Ryu,C.Mac Cormic and
M.G.Boshier,NewJ.Phys., 11,043030(2009)
[2]S.K.Schnlle,E.D.van Ooijen,

M.J.Davis,N.R.Heckenberg,H.Rubinsztei n-Dunlop,Opt.Express,**16**,1405-12(2008) [3]IntraAction 社

http://www.intraaction.com

[4]K.W.Madison,F.Chevy,W.Wohlleben and J.Dalibard,Phys.Rev.Lett.,**84**,806 (2000)